

Medieninformation

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Ihr Ansprechpartner
Falk Lange

Durchwahl
Telefon +49 351 564 60200

falk.lange@smwk.sachsen.de*

11.12.2009

VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH und Fraunhofer- Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik erhalten Fördermittelbescheide

Einladung an die Presse

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Am Montag, 14. Dezember 2009 übergibt Wissenschaftsministerin Prof. Sabine von Schorlemer Fördermittelbescheide über insgesamt 7,9 Millionen Euro an die VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH und das Dresdner Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP). Es sind die ersten Fördermittelbescheide zur Technologieförderung aus dem Wissenschaftsministerium. Das Ministerium ist seit dem 01. Oktober 2009 für Technologiepolitik und Technologieförderung zuständig.

Zur Übergabe der Bescheide laden wir herzlich ein. Der Termin ist für die Bildberichterstattung besonders geeignet.

Termin: 14.12.2009, 9.30 Uhr

VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH, Hahnweg 8, Dresden-Weißig

Mit freundlichen Grüßen,

Annett Hofmann

Hintergrund:

Bei dem FuE-Verbundvorhaben handelt es sich um "Neue Technologien für solare Anwendungen". In diesem Projekt arbeitet die VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH mit dem Dresdner Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik sowohl an der Entwicklung neuer Verfahrenslösungen zur Abscheidung verschiedener Funktionsschichten und zur Vorbehandlung von Trägersubstraten als auch an technischen Komponentenlösungen im Stadium von Versuchsmustern für verschiedene Applikationen in der Photovoltaik und der Solarthermie. Der bewilligte

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

Zuschuss beträgt insgesamt 7,9 Mio. €. Davon erhält das Unternehmen 4,6 Mio. € und das Fraunhofer-Institut 3,3 Mio. €. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf 13,2 Mio. €. Davon fallen 8,8 Mio. € auf das Unternehmen und 4,4 Mio. € auf das Fraunhofer-Institut. Das Vorhaben hat eine Laufzeit vom 01.09.2009 bis 31.08.2012.

Die VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH ist 1991 aus dem Dresdner Forschungsinstitut Manfred von Ardenne (IvA) hervorgegangen, das seit 1955 außerhalb der staatlichen Planwirtschaft der DDR in privater Rechtsform durch seinen Gründer und Namensgeber geführt wurde. Heute hat das Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Es gehört heute zu den weltweit führenden Anbietern von Elektronenstrahl- und Plasmatechnik und der dazu erforderlichen Ausrüstungen.

Das Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP wurde aus Arbeitsgruppen des früheren Forschungsinstituts Manfred von Ardenne gebildet. Es befasst sich mit der Vakuumbeschichtung sowie die Oberflächenbearbeitung und -behandlung mit Elektronen und Plasmen. Hauptarbeitsgebiete des Fraunhofer FEP sind Dünnschichttechnologie (z.B. Spezial-schichten für Displays, fälschungssichere Etiketten, Spiegel für das Dresdner Grüne Gewölbe) und die Elektronenstrahltechnologie (Härten von Lacken, Verbesserung der Eigenschaften von Kunststoffen, Sterilisierung von Medizinprodukten, Abtötung von Krankheitserregern in Saatgut).